

プロセス堆積物防止に
ガスの凝縮、凝結防止に
クリーニングの頻度を低減しメンテナンス
時間を短縮

右の写真はCVDシステム、プラズマエッチ
ングシステム用のバルブを示す



真空排気時間の短縮

残留ガス分圧の低減によりプロセスの
安全性向上

右の写真はUHV、スパッタリングシステム、
研究開発用のバルブを示す



VAT社によるエンジニアリング協力

VAT社には、次のような問題解決に経験があります。

- お客様のシステムコンセプトへの統合組込み
- クリーンルームへの対応
- 均一な温度分布
- バルブ組込み型ヒーター
- 不慮の接触事故防護対策
- 簡単な取付け

VAT社にご相談戴ければ、お客様のヒーターについてのご要望に最適の解決策を
提供できます。